

「SEMICON Japan 2019」出展のご案内

拝 啓

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

芝浦メカトロニクスグループは、12月11日（水）～13日（金）、東京ビッグサイトで開催される『SEMICON Japan 2019』に出展いたします。

芝浦メカトロニクス(株)は、長年培ってきたコア技術（精密メカトロニクス、洗浄、成膜、エッチング、真空、貼り合せなど）を結集して、半導体、電子部品、フラットパネルディスプレイ、光学薄膜などの用途向けに製造装置の開発からサービスまでトータルソリューションを提供しています。

また、芝浦エレテック(株)は「心と技術で未来をつくるサービス会社」として様々な協力会社様と連携し、ワンストップサービスを提供しています。

是非この機会に、芝浦メカトロニクスグループの新しい技術をご覧いただきたく、ご来場をお待ち申し上げます。

敬 具

- 記 -

日 時 : 2019年12月11日（水）～13日（金） 10:00～17:00
会 場 : 東京ビッグサイト 西展示棟・南展示棟・会議棟
展示ブース : 西展示棟 Hall1 小間番号 2024
Web サイト : <https://www.semiconjapan.org/jp/>



出展品目 :

■ 芝浦メカトロニクス株式会社

1) パネル展示

先端レチクルエッチングシステム (ARES Series)
枚葉式リン酸エッチング装置 (SC301-HT8)
ダメージフリー等方性エッチング装置 (CDE Series)
最先端パッケージ用高精度ボンディング装置 (TFC-6500)
FO-PLP 用高精度ボンディング装置 (TFC-9300)
EMI シールド用スパッタリング装置 (CCS2110)

■ 芝浦エレテック株式会社

1) 実機展示

IoT サービスツール キノシステム®
目視外観検査用ステージ (Model VIS2)
ウェーハ用アライナ (Model ALV2)
ガスフローコントローラ (GFC)

2) モニタ展示

IoT サービスツール マルチインフォメーションシステム
装置リノベーション事例 etc

- 以上 -

【ご注意】 本状に同封している「SEMICON Japan 案内状」では展示会に入場できません。

展示会 Web サイトから事前登録していただきますようお願いいたします。

【お問い合わせ先】

芝浦エレテック株式会社 経営戦略センター 企画担当

e-mail : esc@shibaura.co.jp

web サイト : <https://www.shibaura.co.jp/eletec/>

芝浦エレクトック株式会社 出展品目のご紹介

■ 実機展示

IoT サービスツール キノシステム®



- ・ 生産設備のリアルタイムの状況を把握できる IoT サービスツール キノシステム®を出展します。お客様のニーズに合わせたカスタマイズにも対応します。

ウェーハ用アライナ (Model ALV2)



- ・ 300mmウェーハ位置決め、ノッチ合せを高精度に行うユニット
- ・ 各種半導体製造装置、ウェーハ検査装置の「カセット収納時のノッチ合わせ」「ウェーハ ID 読み取り用の位置決め」などでご使用いただけます。

目視外観検査用ステージ (Model VIS2)



- ・ 300mm ウェーハの目視検査用ステージユニットです。
- ・ ウェーハのエッジをグリップし、自由自在に目視ができます。
- ・ 手動でも自動でも制御が可能です。

ガスフローコントローラ (GFC)



- 従来のマスフローコントローラの機能・性能を大幅に改善・向上
- ・ 広範囲な流量レンジ ・ 圧力/温度変動の影響を受けない
 - ・ 高精度な流量制御 ・ リアルタイムモニタリング機能
 - ・ 高速な応答性 (立ち上り/立ち下り速度)
 - ・ 圧力/温度変動の影響を受けない

■ モニタ展示

IoT サービスツール マルチインフォメーションシステム



- ・ 「見えない」生産現場を “見える” 生産現場に！
工場内の様々な情報を統合し、生産現場にあった情報を、必要な人に受け取りやすいカタチで迅速にお届けし、生産性の向上にお役に立ていただけます。

装置リノベーション事例



- ・ 旧式の装置が蘇える！
外観を再塗装し、内部機器を交換し、機能を蘇らせます。新たな機能の追加も可能です。
- ・ リアルタイムモニタリング機能